

資料3-1-4 中央顕微鏡施設

〈中野キャンパス ～2009年度〉(顕微鏡室)

A棟2階 (66m²) 1963年度設置.

透過型と走査電子顕微鏡が設置され、生物試料等の観察、分析が行われた。他の機器としては、超マイクロトーム、凍結試料作製装置、真空蒸着装置、イオンスパッタリング装置、臨界点乾燥装置、凍結乾燥装置、ガラスナイフ作製機が設置されていた。

〈柏キャンパス〉

2階 (233m²) 2010年度設置.

透過型ならびに走査型電子顕微鏡(EDX装備)と電子プローブマイクロアナライザー、蛍光X線分析装置などを設置し、試料作製から観察や分析までを施設内で効率的に行うことができる。上記以外の主要機器には、超マイクロトーム、金属蒸着装置、凍結乾燥装置、ディスコプラン、アイソメットなどが設置されている。

●中央顕微鏡施設設置機器一覧

機器名	メーカー	型番号	購入年度
蛍光X線分析装置	リガク	ZSX PrimusII	2009
電子プローブマイクロアナライザー	日本電子	JXA8230(2CH)	2009
電子プローブマイクロアナライザー	日本電子	JXA8900(5CH)	1997
真空蒸着装置	日本電子	JEE-420(カーボン)	2009
ディスコプランTS新型	ストルアス		2004
ディスコプランTS旧型	ストルアス		1981
ポリリッシャー一式 (PotoPol-35+ PdM-Force20)	ストルアス		
アイソメット	ビューラー		2008
超マイクロトーム		REICHERT	1993
		LKB-V	1980
金属蒸着装置		JFC-1100(金蒸着)	1980
		E-1030(白金・パラジウム蒸着)	1993
凍結乾燥装置		JFD-300	1991
ガラスナイフ作製機		LKBナイフメーカーII	1986
透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-1400	2009
走査電子顕微鏡 (EDX装備付属)	日立製作所・堀場製作所	S-4800/EX-2500	2009
引伸機		オメガPRO-LAB4x5	1978
		ダースト	1993